

VACUUM - PVD THIN FILMS - LEAK TESTING - PLASMA

PVD - EVA



allianceconcept



Fiables, évolutifs, compacts et performants, les bâtis EVA vous garantissent la qualité de vos dépôts pour des décennies.

Fort de plus de **30 ans de savoir-faire** en matière de technologie sous vide et des procédés d'évaporation, nous proposons **diverses configurations de sources** telles que le canon à électrons et les sources thermique par effet Joule, cellules d'effusion.

Les **solutions IAD** (Ion Assisted Deposition) disponibles sur les équipements, permettent la **densification par faisceau d'ions**. Le contrôle des procédés est réalisé par des techniques de surveillance sophistiquées, **quartz et/ou optique**, garantissant une **précision** et une **fiabilité élevées**.

Bâtis gamme EVA

EVA 300

Fiable & Compact



EVA 450 / 451

Flexibilité & Précision



EVA 600 / 601

Polyvalent & Modulable



EVA 760

Performance & Adaptabilité



EVA 900

Production & Agilité





Les sources de dépôt possibles

Effet Joule

- Nacelles
- Filaments
- Fours



Canon à électrons

- Multi-croiset
- Mono-croiset
- Multi-source



Nous développons **nos propres sources Joule** ainsi que leur **alimentation** de puissance dédiée.

Chaque source est équipée d'un **cache piloté** par le contrôleur d'épaisseur.

	EVA 300	EVA 450	EVA 600	EVA 760	EVA 900
Diamètre enceinte	300 mm	450 mm	600 mm	760 mm	900 mm
Hauteur	450 mm	600 mm	800 mm	920 mm	1050 mm
Volume	60 litres	120 litres	290 litres	520 litres	865 litres
Vide limite	5.10 ⁻⁷ mbar[1]		5.10 ⁻⁸ mbar[2]		
IAD	Non	Oui, en option			
Mesure quartz	Latérale			Centrale	
Capacité dôme	4 x 4"	7 x 4"	15 x 4"	20 x 4"	26 x 4"
Planétaire	Non		Oui, en option		
Uniformité	< +/- 5% [3]				
Possibilité sas	Non	Oui, EVA 451	Oui, EVA 601	Non	
Implantation passe-paroi	Non	Oui			
Pilotage machine	Semi-automatique	AC3000			

1- Valeurs mesurées sur équipements et pas simulées, configuration turbomoléculaire

2- Valeurs mesurées sur équipements et pas simulées, configuration cryogénique

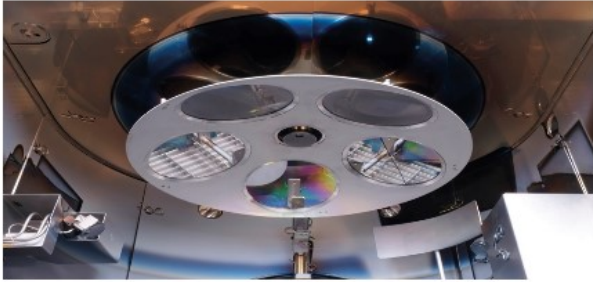
3- Uniformité calculée selon formule $U(\%) = \frac{(E_{max} - E_{min})}{(E_{max} + E_{min})} \times 100$, sans cache d'uniformité



Contrôle optique in-situ

Pour parfaire votre configuration, optez pour l'intégration d'un contrôleur optique. Mesure **directe** ou sur **verre témoin**, mesure en **réflexion** et/ou **transmission**, ce système vient en complément de la mesure par quartz. Il sera votre partenaire idéal pour l'élaboration **d'empilements optiques complexes**.

Le système optique présente les caractéristiques suivantes :



- Gamme spectrale : 400 - 2400 nm
- Source broad band
- Module de contrôle

DISPONIBLE À PARTIR DE L'EVA 600

Notre savoir-faire en évaporation sous vide représente la synergie parfaite entre **recherche** et **besoins industriels**. Nous sommes fiers de contribuer à l'avancement des technologies dans des domaines aussi cruciaux que l'optique, la microélectronique et le spatial, et nous nous engageons à continuer **d'innover** pour répondre aux **défis de demain**.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

 Anancy, FRANCE

4 AVENUE DU PONT DE TASSET
74960 ANNECY - FRANCE
TÉL. : +33 (0)4 50 57 93 85

CONTACT@ALLIANCE-CONCEPT.COM
WWW.ALLIANCE-CONCEPT.COM

